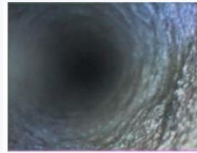
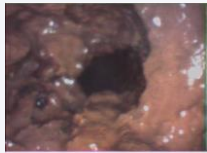


カーボンニュートラルへの取り組み

二次冷却システム (UWT)の導入

- ①水の酸化による錆、スライム、スケールの発生を
極限まで削減しメンテナンス頻度、汚排水を大幅削減



対策前

対策後

- ②冷却効率のアップ・ポンプのインバーター制御により
ポンプ出力を20%DOWN

年間16,260Kg-CO₂削減

省エネ生産

半導体資材タクトアップ(30m/m⇒100m/m)

タクトアップにより1mあたり消費電力70%減

年間107,178Kg-CO₂削減

シャーレタクトアップ・歩留改善

生産タクト10.4%アップ、歩留3.9%改善により
消費電力14.3%減、材料ロス3.9%減

年間181,035Kg-CO₂削減

Save the Planet



電動成形システム 半導体資材設備更新

電動式射出成形機の全面展開

油圧式射出成形機に比べ、消費電力44%減

年間212,058Kg-CO₂削減

半導体資材設備更新

新型設備導入により消費電力40%減

年間14,207Kg-CO₂削減

工場緑化率の維持・拡大



工場敷地内緑地45.2%※

※工場立地法上の緑地率は26.6%